

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 1 区分

【発行日】平成25年10月31日 (2013.10.31)

【公開番号】特開2012-85605(P2012-85605A)

【公開日】平成24年5月10日 (2012.5.10)

【年通号数】公開・登録公報2012-018

【出願番号】特願2010-237174(P2010-237174)

【国際特許分類】

C 1 2 N 15/09 (2006.01)

C 1 2 M 1/00 (2006.01)

C 1 2 Q 1/68 (2006.01)

【F I】

C 1 2 N 15/00 A

C 1 2 M 1/00 A

C 1 2 Q 1/68 A

【手続補正書】

【提出日】平成25年9月12日 (2013.9.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

核酸増幅反応の反応場となる反応領域と、
前記反応領域に光を照射する照射手段と、
反射した光の光量を検出する光検出手段と、を備え、
前記照射手段からの光照射によって発生する反応領域の側方光を反射して前記光検出手段に導光する反射部材を有する、核酸増幅反応装置。

【請求項 2】

前記反射部材が、前記反応領域からの側方光を光出射面方向及び / 又は光入射面方向に導光するように前記反応領域周辺に配置されている請求項 1 記載の核酸増幅反応装置。

【請求項 3】

前記反応領域と前記反射部材との間に単数又は複数の蛍光体部材を設ける請求項 1 又は 2 記載の核酸増幅反応装置。

【請求項 4】

核酸増幅反応の反応場となる反応領域からの側方光を反射する反射部材を備える基板。

【請求項 5】

更に、前記反応領域と前記反射部材との間に蛍光体部材とを備える請求項 4 記載の基板。

【請求項 6】

光照射によって発生する核酸増幅反応の反応場となる反応領域からの側方光を、当該反応領域周辺に配置した反射部材にて光出射面方向及び / 又は光入射面方向に導光し、導光された光の光量を光検出器にて検出する核酸増幅反応方法。

【請求項 7】

前記側方光が側方散乱光であり、当該側方散乱光を蛍光体部材に透過させた蛍光の光量を検出する請求項 6 記載の核酸増幅反応方法。